

即時リリース

投資家向け広報窓口：

Ed Lockwood

インベスターリレーションズ部門シニアディレクター

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

メディア向け広報窓口：

Meggan Powers

コーポレートコミュニケーション部門シニアディレクター

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor が新しい計測装置で 5D™パターンコントロールソリューションを拡張
包括的なオーバーレイと成膜プロセス制御ソリューションが多様な IC プロセスの課題を解決

カリフォルニア州ミルピタス発(2015年2月19日)。 [KLA-Tencor Corporation \(NASDAQ:KLAC\)](#) は本日、16nm 以下の IC デバイスの開発および量産をサポートする2つの高度な計測装置、Archer™ 500LCM と SpectraFilm™ LD10 を発表しました。Archer 500LCM オーバーレイ計測装置は、歩留まり改善のあらゆる段階を通してオーバーレイ誤差の正確なフィードバックを提供することで、半導体メーカーが、マルチパターンニングやスペーサピッチ分割などの新規パターン形成手法に関連するオーバーレイの問題を解決する支援をします。SpectraFilm LD10 膜計測装置では、膜の厚さおよび膜ストレスを信頼性の高い正確な測定を通じて、FinFET、3D NAND およびその他の最先端デバイスの製造で使用される膜および積層膜の特性管理及びプロセスモニタが可能です。新しい装置は、KLA-Tencor 独自の [5D™パターンニングソリューション](#) における主要製品であり、ファブ全体のプロセスの特性評価とモニタを通じて最適なパターン形成に貢献します。

「当社は、非破壊的光学計測における業界リーダーとして、パターンオーバーレイ、微小寸法、および膜の品質を最適化し、課題を理解するためにお客様と密接に協力してきました。ファウンドリ、ロジックおよびメモリ製造全体で、お客様は、複雑なプロセスの問題を解明するために、量産に適したデータを提供する計測装置を必要としています。新しい Archer 500LCM や SpectraFilm LD10 などのフル装備の計測装置は、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できる複数の技術革新を実装しているため、現在のノードの歩留向上、次世代ノードデバイスの開発に貢献します」と、KLA-Tencor のパラメトリックソリューショングループ担当副社長 Ahmad Khan は述べています。

イメージングおよび独自のレーザベースのスカットロメトリ測定技術の両方を装備する Archer 500LCM オーバーレイ計測装置には、さまざまな計測オプションが用意されており、ダイ内、微細なピッチ、多層ターゲットなどの多種多様なオーバーレイ測定ターゲットの

デザインをサポートしています。このような柔軟性は、スキャナ補正やインライン異常の特定に使用できる正確なオーバーレイのデータを効率よく生成できるため、エンジニアは、厳しいパターン形成要件を満たすためのウエハリワーク、プロセス調整の判断を正確に行うことが出来ます。世界中のファウンダリ、ロジックおよびメモリメーカーで複数の **Archer 500LCM** システムが採用されており、量産および次世代デバイスの開発で、オーバーレイの管理に貢献しています。

SpectraFilm LD10 には、レーザ励起のプラズマ光源が組み込まれており、**FinFET** などの複雑なデバイス構造、形成に使用される薄膜多層積層膜を含めた幅広いアプリケーションに対応し、信頼性の高い精密な膜厚測定データを生成します。新しく搭載された赤外波長のサブシステム技術により、**3D NAND** フラッシュデバイス等で使用される厚い多層積層膜の特性評価が可能です。旧世代の **Aleris®** プラットフォームに比べてスループットが大幅に向上した **SpectraFilm LD10** は、高い生産性を維持しながら、複数のパターン形成プロセスや他の最先端の製造プロセスに関連する多くの積層膜を計測します。**SpectraFilm LD10** は、高度な最先端の **IC** 開発および量産現場で使用するために多数受注しています。

Archer 500LCM 装置および **SpectraFilm LD10** 装置は、**CD** 及びプロファイル計測のプラットフォームを持つ **SpectraShape™ 9000**、高度なデータ解析処理機能を持つ装置 **K-T Analyzer®**、その他の多くのプロセス制御装置と統合されて、**KLA-Tencor** の包括的な **5D** パターンコントロールソリューションをサポートします。最先端の **IC** 製造で要求される高い性能と生産性を維持するために、**Archer 500LCM** および **SpectraFilm LD10** は **KLA-Tencor** のグローバルで、[包括的なサービスネットワーク](#)によって支えられています。詳細については、**5D** [コントロールソリューションの Web ページを参照してください。](#)

KLA-Tencor について :

KLA-Tencor Corporation は、プロセス制御および歩留まり管理ソリューションにおけるリーディングカンパニーであり、検査および計測装置の最先端技術をお届けするパートナーとして世界中のお客様に信頼されています。これらの技術は半導体、**LED**、その他の関連ナノエレクトロニクス業界で利用されています。業界標準の製品ポートフォリオと世界に誇る研究者チームによって、**35** 年以上にわたりお客様に優れたソリューションを提供してきました。**KLA-Tencor** は、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、世界中に販売およびサービス拠点が 있습니다。詳細については、<http://www.kla-tencor.com> (**KLAC-P**)をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに記載されている過去の事例以外の事項、すなわち **Archer 500LCM**、**SpectraFilm LD10** および **5D** パターンソリューションに期待される性能、次世代テクノロジーノードへの拡張性、**KLA-Tencor** の顧客により見込まれる **Archer 500LCM**、**SpectraFilm LD10** および **5D** パターン形成制御ソリューションの用途、これらの使用により実現可能な予想されるコストおよび運用上の利点およびその他の利点は将来の見通しであり、**Private Securities Litigation Reform Act of 1995** (1995 年私募証券訴訟改革法)の **Safe Harbor** (セ

ーフハーバー)条項が適用されます。これらの見通しは現時点での情報と予想によるものであり、多くのリスクと不確定要素を含んでいます。新技術の採用の遅延(コストまたは性能上の問題などの原因による)、他社による競合製品の発売、当社製品の導入、性能、または使用に影響を及ぼす予期せぬ技術的な問題や限界など、さまざまな要因により、実際の結果はこれらの記述で予想された内容と著しく異なる場合があります。

###